⑩日本国特許庁(IP)

(11) 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-135550

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成 4年(1992) 5月11日

A 61 B 10/00 G 01 B 11/24 G 01 N 21/84 ECZ

7831-4C 9108-2F 2107-2 J

未請求 請求項の数 1 (全10頁) 審査請求

60発明の名称

断層像観察用光走查装置

20特 願 平2-259914

守

願 平2(1990)9月27日 20出

@発 明 者 上 邦

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

金 子 明 個発 者

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

正一 明 73発 五反田

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

株式会社内

オリンパス光学工業株 会出 願人

式会社

弁理士 伊藤 進

最終質に続く

网代 理 人

1. 発明の名称

断層像觀察用光走查装置

2. 特許請求の範囲

被検体内部に挿入する挿入部に、断層像観察の ための光を前記挿入部から放射状に走査する手段 を備えたことを特徴とする断層価観察用光定査装 覆。

3. 発明の詳細な製明

[産業上の利用分野]

本発明は断層像観察のための光を走査し、被検 体の内部情報の可視化を容易とする断層像観察用 光走査装置に関する。

[従来技術]

近年、診療における画像利用が替及し、被検体 の内部情報を無侵襲的、非接触的に計測する技術 の重要性がますます高まっている。

従来、生体などの被検体内部の情報の無侵盤的、 非接触的な計測は、主としてX段によって行われ ていたが、このX線の使用は、放射線被傷の問題

や生体機能の画像化が困難という問題があり、超 音波内視鏡による体腔内組織の透視が行われるよ うになった.

しかしながら、前記超音波内視鏡は、空間分解 能があまり高くなく、形態以外の生理的組成など の情報を知ることはできない。さらに前記超音波 内視鏡の使用に際しては、水などの媒体が必要で あるため、被検体の観察に際しての処置が蓄雑で あるという問題がある。

このため、最近では、光を用いて被検体内部の 情報を可視化する光CTに係わる技術が種々提案 されており、例えば、特開平1-209342号 公報に、その先行技術が開示されている。

[発明が解決しようとする課題]

前記光CTなどによる断層像観察においては、 既 層 像 観 察 のため の 光 を 導 く 挿 入 部 を 被 検 体 内 部 へ挿入し、この挿入部を湾曲動作させるなどして、 適切に光走査が行われるようにする必要がある。

しかしながら、従来、前記挿入部外間に位置す る観察部位の断層値を将ようとする場合などには、 前記挿入部の複雑な湾曲操作などが必要となり、 光定変が不適切となるおそれがある。

さらに、前記挿入部の挿入が可能な被検体内部の空間が極めて狭い場合などには、前記挿入部の動きが制限されて適切な光定変が行なえず、希望する断層像が得られない可能性がある。

本発明は上記事情に盛みてなされたものであり、断層像観察に必要な光の走査を、簡単な操作で、しかも、確実に行なうことのできる断層像観察用光走査装置を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段及び作用]

本発明の断層像観察用光走査装置は、被検体内部に挿入する挿入部に、断層像観察のための光を前記挿入部から放射状に走査する手段を備えており、この手段により光走査が容易に行なえる。
[実態例]

以下、図面を参照して本発明を具体的に説明する。

第1図~第3図は本発明の第1実施例を示し、 第1図は断層像観察用光走査装置の復略構成図、

レンズが設けられ、この対称レンズの結像位置に、 イメージガイド11の先端面が配置されている。 このイメージガイド11は、辨記挿入部1内を挿 遥され、後端面が図示しない接限部内の接限レン ズに対向している。そして、辨記対物レンズによって結像された観察部位の光学像が前記イメージ ガイド11によって導かれ、前記接限部から内限 観察が可能なようになっている。

また、前記挿入部1には、断層像観察のための 光を放射状に走査する手段としての光ファイバ束 2が設けられ、この光ファイバ東2は、前記挿入 部1外周囲に複数の光ファイバ12が環状に配設 されて構成されている。

第2図に示すように、前記光ファイバ12の先 遠は、前記先端部6の外周側に前記チャンネル部 6 a を囲根するよう配設されており、第3図に示 すように、先端がファイバ軸に対して、例えば4 5°にカットされてテーバ面12 a が形成されて いる。

そして、このテーパ面12aに、アルミニウム、

第2図は光ファイバの配置を示す説明図、第3図 は光ファイバの先端形状を示す説明図である。

第1図に示すように、断層像観察用光走査装置は、被検体内部に挿入される細長で可挽性を有する挿入部1と、断層像観察のための光を出射するとともに、被検体内部からの反射光を受光する送受光装置3と、ガルバノメータ4と、このガルパノメータ4を制御する制御回路5とを備えている。

前記押入部1は、例えば内視鏡の挿入部として 構成され、先端部6のチャンネル部6aに、照明 窓7、観察窓8、及び、吸引チャンネル9などが 形成されている。

前記照明窓7の内側には図示しない配光レンズが装着され、この配光レンズの後端にライトガイド10が連設されている。このライトガイド10は、前記挿入部1内を挿通されて図示しない光波装置に接続され、この光波波がらの照明光を伝送して前記照明窓7から被検体の観察部位に照射するようになっている。

また、前記観察窓8の内側には図示しない対称

観、金などが蒸着されてミラー面が形成されるとともに、このミラー面が解記挿入部1先端で内間になるよう配列され、前記送受光装置3からの光をファイバ軸倒方に放射し、また、被検体内部から反射された反射光をファイバ軸方向に入射するようになっている。

また、前記送受光装置3の内部には、例えばヒコ サ単位の光パルスを出射するパルスレーザ、このパルスレーザから出射される光パルスの光路を形成するためのレンズ及びミラー群、及び、 畳像手段などを備えている。

前記送受光装置3のパルスレーザーから光パルスが出射されると、この光パルスの出射に連動して前記制御回路5により前記ガルバノメータ4のミラー4aの振り角が制御され、前記光ファイバ東2の各光ファイバ12へ入射されるようになっている。

尚、前記光ファイバ12は、端部にテーパ面1 2 aを形成せずにプリズムを配置しても良く、また、前記光ファイバ12に代え、第4図に示すよ うに、先端部13aを前記挿入部1から外側方向 に曲げた光ファイバ13を使用して前記光ファイ パ束2を構成しても良い。

次に、前記断層像観察用光走査装置を用いた光 断層像観察について説明する。

例えば、人体臓器の患部の光断層像を観察する場合、まず、挿入部1を体腔内部に挿入する。次いで、先端部6外周側が患部位置に達したら、送受光装置3内のパルスレーザーより、半値幅が数ピコ秒の極めて時間幅の短い光パルスを発生させ、この光パルスをガルパノメータ4のミラー4aで反射させて光ファイバ東2を構成する各光ファイバ12に入射させる。

該記各光ファイバ12に入射された光パルスは、 先端のテーパ面12aで反射されてファイバ軸側 方へ放射され、前記光ファイバ東2から外側に向 かって放射状に光走査が行われる。そして、 思部 に照射された光が組織表面及び内部で反射される と、この反射光が、前記光ファイバ東2から前記 ガルバノメータ4のミラー4 a を経て前記送受光

第6因及び第7因は本発明の第2実施所を示し、 第6因は光断層像観察のためのシステム構成因、 第7因はプロープ保持パルーンを示す説明図である。

この第2実施例は、前述の第1実施例に対して シングルファイバを用い、このシングルファイバ 先端に配置したミラーを回転させて機械的に光定 変を行なうものである。

第6図に示すように、光断層像観察のためのシステムは、プローブ21と、光断層処理制御部22と、画像処理装置23と、前記プローブ21の光走査駆動を制御する制御回路24とを備えている。

前記プローブ21は、被検体内部に挿入される 細長で可換性を有する挿入部25と、この挿入部 25の基部側に設けられた太幅の操作部26とを 有し、前記挿入部25先端側には、先端が閉塞さ れた円筒状の選光性カバー27が装着されている。

また、前記博入部25のほぼ軸心上に、前記光 断層処理制御部22に接続される光ファイバ28 装置3内に専光され、内部のレンズ及びミラー群 を経て、例えばストリークカメラなどの機像手段 に入射される。

育記ストリークカメラでは、育記反射光の時間 分解波形を検出し、この時間分解波形を図示しない処理装置で処理することにより観察部位の断層 像が得られ、図示しない表示装置に表示される。

すなわち、前記挿入部1を被検体内部に挿入して断層像を観察する場合、前記挿入部1の複雑な湾曲操作を要することなく、前記挿入部1の先端部6外周側を観察部位まで挿入するのみで、前記挿入部1から放射状に光定変が行われるため、希望する観察部位の断層像が容易に得られるのである。

商、前記ガルバノメータ4に代え、第5回に示すように、前記光ファイバ東2と前記送受光袋置3との間に、AOM(音響光学素子)14を配置し、このAOM14を制御回路15で制御することにより、前記送受光装置3からの光を走査制御するようにしても良い。

を内蔵したフレキシブルシャフト29が排通され、このフレキシブルシャフト29の先端側が軸受3 0により回転自在に支持されている。さらに、前記近光性カパー27内に露呈する前記フレキシブルシャフト29先端に、前記フレキシブルシャフト29の軸心に対して例えば45°の傾斜角を有するミラー31と、このミラー31からの反射光を配光するためのレンズ32とが設置されている。

また、前記フレキシブルシャフト29の前記操作部26頃には、ギア33が外嵌固定され、このギア33にギア34が鳴合している。このギータ35にはエンコーダ36が建設されている。前記モータ35には前記エンコーダ36からの信号が入力されて前記モータ35の回転が制御されるようになっている。

前記光販層処理制御部22は、例えば色素レーザーとNd: YAGレーザーとを組合わせたパルスレーザー37を備え、前記Nd: YAGレーザ

ーの出射光が色素レーザー内の色素(例えばRhodamine G)に照射され、この色素レーザーの出射光がレンズ38により収束されてピームスプリッタ39によって2つに分離されるようになっている。

前記ピームスプリッタ39を選過した光は、さらにピームスプリッタ40を選過してレンズ41にて集光され、前記プローブ21の光ファイバ28を経て観察部位に照射される。また、観察部位からの反射光は、前記レンズ41を通り、前記ピームスプリッタ40で反射されてピームスプリッタ42を透過し、KDP43などの非観形光学素子に入射される。

一方、前記パルスレーザー37から出射され、 ビームスプリッタ39で反射された光は、遅延ミ ラー装置44のミラー44a、44bで反射され、 ミラー45を経て前記ピームスプリッタ42で反 射され、参照光として前記KDP43に入射され るようになっている。

光電子増倍管47で検出することができる。

次に、本実施例の作用について説明する。

プローブ21の挿入部25を生体などの被検体内部に挿入し、この挿入部25の先端側を観察部位に位置させ、次いで、光断層処理制御部22内のパルスレーザ37より数ピコ秒の光パルスを出射させる。この光パルスは、ピームスプリッタ39、40を透過し、レンズ41を介して光ファイバ28に入射され、この光ファイバ28内を導かれて先端面から出射される。

前記 K D P 4 3 は、観察部位からの反射光と前記参照光とを入力することにより、第 2 高調波を発生する。この第 2 高調波はフィルタ 4 6 を通過して光電子増倍管 4 7 により被出されるようになっており、前記フィルタ 4 6 は、前記パルスレーザー 3 7 の出射光の波長を入としたとき、第 2 高調波である波長入/2 を含む狭い帯域を通過させる特性となっている。

また、前記選延ミラー装置44は、互いに対向するミラー44a, 44bが可動ステージ44cに固定され、この可動ステージ44cを移動させる移動装置44dがモータ44eによって駆動されて前記参照光の光路長を変化させるようになっている。

前記 K D P 4 3 が発生する第 2 高 関波の強度は、前記 反射光と参照光をそれぞれ時間の 関数とした場合の反射光と参照光の積の積分値に比例するため、前記ミラー 4 4 a a 4 4 b を移動させて参照光の光路 長を変化させることにより、観察部位内部からの反射光の任意の時間成分の強度を、前記

京記光ファイバ28から出射された光パルスは、 透光性カバー27内に載呈するフレキシブルシャ フト29先曜のミラー31で反射され、レンズ3 2を介して前記挿入部25関方に出射されて観察 部位に照射される。

そして、照射された光パルスが、生体組織表面 及び内部の屈折率の異なる境界面で反射されると、 反射光パルスが前記光ファイバ28により前記光 断層処理制御部22に導かれ、前記レンズ41に により集光されて前記ピームスプリッタ49で反 射され、ピームスプリッタ42を透過してKDP 43に入射される。

このとき、前記パルスレーザー37より出射されビームスプリッタ39にて分離された光パルスは、ミラー44a、44b→ビームスプリッタ45→ビームスプリッタ42へと導かれ、このビームスプリッタ42で反射されて前記KDP43に参照光として入射される。

この K D P 4 3 で発生した第 2 高調波は、フィルタ 4 6 を介して光電子増倍管 4 7 により校出さ

れ、さらに、ロックインアンア48を経てA/D コンパータ49によりデジタル信号に変換されて コンピュータ50に入力される。

同時に、前記アローブ21の操作部26に内蔵されたモータ35が、エンコーダ36の出力に基づいて制御回路24によりフィードバック制御され、一定の回転数で回転させられる。前記モータ35の回転は、ギア33、34を介して前記マレキシブルシャフト29先盛の前記ミラー31が回転させられる。

そして、前記挿入部25から放射状に光走査が行われて上記動作が疑返されると、観察部位の各位置での反射光の時間成分の強度が検出され、前記制御回路24からの走査位置情報とともに前記コンピュータ50にて処理される。その結果、観察部位の光断層像が構築され、図示しない表示器に表示される。

この第2実施例においても、前述した第1実施 例同様、光断層像の観察に際して、前記挿入部2

ビデオアロセッサ62及び光断層処理装置63と、 前記ビデオアロセッサ62に接続されるモニタ6 4とを確えている。

前記内視鏡60は、細長で可提性を有する挿入部65と、この挿入部65の後端に連設された操作部66と、この操作部66の関部から延出されたユニバーサルコード67とを備えている。

育記ユニバーサルコード67内には、育記光淑 装置61からの照明光を伝送する図示しないライトガイドが挿過されており、また、前記ユニバー サルコード67の蟷部には、前記光源装置61に 者脱自在に接続される光源コネクタ68が設けられている。この光源コネクタ68からは、信号ケーブル69の 蟷部に、前記ピデオプロセッサ62に着脱自在に 接続される信号コネクタ70が設けられている。

また、前記操作部66には、前記挿入部65に設けられた海曲部を海曲操作するための海曲操作ノブフ1と、ライトガイド駆動部フ2とが設けられ、このライトガイド駆動部フ2と前記光断層処

5 の複雑な溶曲操作を要することなく、希望する 観察部位の光断層像を容易に得ることができる。

ところで、前記プローブ21を用いて光断層像 観察を行なう際には、第7図に示すように、前記 挿入部25に装着したプローブ保持用パルーン5 1を使用することが望ましい。

この場合、前記押入部25を被検体内部に押入し、先端部が観察部位に達したとき、送吸気用チャンネル52から前記パルーン51に送気することにより、前記挿入部25の位置がずれないよう保持することができ、被検体内部からの反射光強度が小さい場合などの積分値に対し、ノイズを低減してS/N比を向上させることができるという利点を有する。

第8 図以下は本発明の第3 実施例を示し、第8 図は光断層像観察のための内視鏡装置の構成図、 第9 図はシステム構成図、第10 図は光ファイバ 用外装チューブの構成を示す断面図である。

第8回に示すように、内視鏡装置は、内視鏡6 0と、この内視鏡60が接続される光源装置61,

理装置 6 3 とが、ライドガイド 7 3 を介して接続されている。

また、前記挿入部65の先端部74の側部には、 観察窓75と2つの照明窓76が設けられ、前記 先端部74の最前端部には、先端が閉塞された円 筒状の選光性カバー77が装着されている。

さらに、前記挿入部65及び操作部66内には、 先端側が前記透光性カバー77内に連通し、後端 側が前記ライトガイド駆動部72に接続されたチャンネル78が設けられている。

第9因に示すように、前記観察窓75の内側には、対物レンズ79が設けられるとともに、この対物レンズ79の結像位置にCCD80が設けられ、このCCD80に駆動回路81が接続された信号線82は、挿入部65、進作部66、ユニバーサル69は、挿入部65、進作部66、ユニバーサル69内を挿通されて信号コネクタ70に接続され、この信号コネクタ70に接続されるようになっている。

また、前記チャンネル78内には、光町層像観察のためのライトガイド83が搾通されている。このライトガイド83の先場面には、前記透光性カバー77内に配設され、光軸を先端部74の関方に向けるアリズム84が固着されている。

一方、前記ライトガイド83の後端部は、前記 ライトガイド駆動部72内に導入されており、前 記ライトガイド駆動部72内において、前記ライ トガイド83の後端部に円筒状の口金85が固定 されている。また、前記ライトガイド駆動部72 内には、前記口金85を回転自在に支持する軸受 86が設けられ、前記口金85にギア87が外嵌 固定されて、このギア87にギア88が暗合して いる。

前記ギア88は、第1のパルスモータ89の出 力軸に固定され、この第1のパルスモータ89及 び前記軸受86は、ラック90に固定されている。 さらに、このラック90には、第2のパルスモー タ91の出力軸に固定されたピニオン92が鳴合 している。

トガイド 8 3 から前記ピームスプリッタ 4 0 に導かれ、このピームスプリッタ 4 0 で反射されてビームスプリッタ 4 2 を透過し、前記ライドガイドフ3内の光ファイバ東 7 3 b を経て KDP 4 3 に入射されるようになっている。

一方、前記パルスレーザー37から出射され、ピームスプリッタ39で反射された光は、選延ミラー装置43のミラー44a、44bで反射され、さらに、ミラー45を経て前記ピームスプリッタ42で反射され、前記光ファイバ東73bを経て参照光として前記KDP43に入射されるようになっている。

そして、前述の第2実施例と同様、前記 K D P 4 3 からの第2高調波がフィルタ 4 6 を通過して 光電子増倍 管 4 7 により 検出され、ロックインアンプ 4 8 、A / D コンパータ 4 9 を軽てコンピュータ 5 0 により 画像 処理される。

前記コンピュータ50で処理された質像信号は、 例えば、前記ビデオプロセッサ62内のスーパー インボーズ回路に入力され、このスーパーインボ 従って、前記第1のパルスモータ89を回転させることにより前記ライトガイド83が回転し、前記第2のパルスモータ91を回転させることにより、前記ラック90を介して前記ライトガイド83が進退するようになっている。

また、前記光断層処理装置63内には、前述の 第2実施例と同様のバルスレーザー37, KDP 43,フィルタ46,光電子増倍管47, 画像処理装置23などが備えられ、前記パルスレーザー 37からの出射光が、前記ライトガイド73内の 光ファイバ束73aを介して前記ライトガイド駆動部72内のレーザーミラー群に入射される。

このレーザーミラー群においては、前述の第2 実施例同様、ビームスプリッタ39によって前記 パルスレーザー37からの出射光が2つに分離され、前記ピームスプリッタ39を透過した光は、 さらにピームスプリッタ40を透過して前記ライトガイド83に入射され、被検体内部の観察部位 に照射されるようになっている。

また、この観察部位からの反射光は、前記ライ

ーズ回路では、内視鏡画像の信号と光断層画像の 信号とを合成し、モニタ64に表示するようにな っている。

次に、本実施例の作用について説明する。

光源装置61からの照明光は、ユニバーサルコード67内の図示しないライトガイドから照明窓76を経て、被検体、例えば臓器96に照射される。この臓器96の光学像は、CCD80によって機像される。このCCD80の出力信号は、ビ

デオアロセッサ 6 2 内の映像信号処理回路によって処理され、この映像信号処理回路からの映像信号がスーパーインボーズ回路を経てモニタ 6 4 に入力され、このモニタ 6 4 に内視鏡画像が表示される。

一方、前記識器96の生体組織97の光断層像を観察する場合には、まず、光筋層処理装置63内のパルスレーザー37より数ピコ砂の光パルスを発生させる。この光パルスは、ピームスプリッタ39.40を透過してライトガイド83に入射され、このライトガイド83からプリズム84を経て、臓器96の生体組織97に照射される。

すると、照射された光パルスに対し、生体組織97内の屈折率の異なる境界面で反射された反射光パルスが、前記ライトガイド83を介して前途した第2実施例と同様の光路を経て導光され、KDP43に参照光とともに入射される。

このKDP43からの第2高調波は光電子増倍 官47で検出され、ライトガイド駆動部72にて 前記ライトガイド83を進退、回転させて観測位

- 1…挿入部
- 2…光ファイバ東
- 3 … 送受光装置
- 4…ガルバノメータ
- 5 … 納伊回路

置を走査しながら上記動作を繰り返すことにより、 生体組織97の光断層像を構成するのに必要なデ ータが取得される。

そして、このデータを光断層処理装置63で処理することにより光断層画像を構築し、ビデオプロセッサ62内のスーパーインボーズ回路により内視鏡画像と光断層画像とを合成してモニタ64に表示させる。

このように本実施例によれば、通常の内視鏡面像の観察とともに、生体組織97の光断層画像の観察が可能となる。その他の作用、効果は前述した各実施例と同様である。

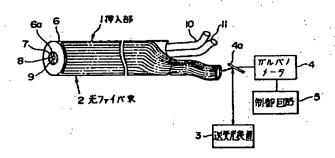
[発明の効果]

以上述べたように本発明によれば、被検体内部 に挿入する挿入部に、断層値観察のための光を前 記挿入部から放射状に走査する手段を備えたため、 光走査が容易に行なえ、確実に断層像を得ること ができるという効果がある。

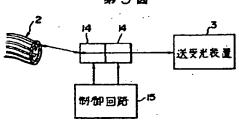
4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図は本発明の第1実施例を示し、





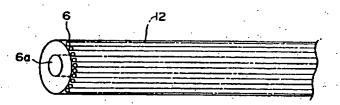
第5図



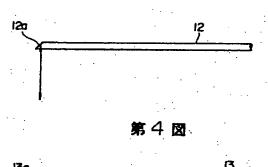
代理人 弁理士 伊 藤



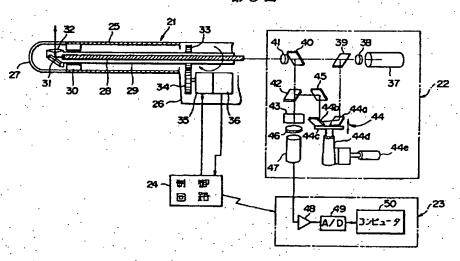
第2図



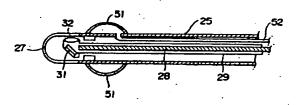
第3図



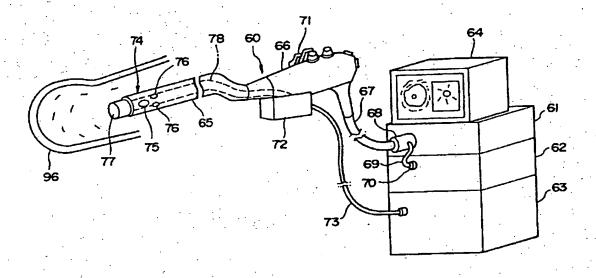
第6図



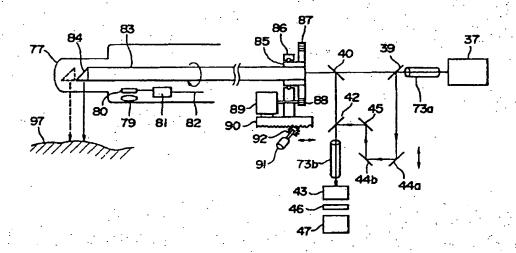
第7図



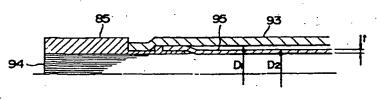
第8図



第9図



第10図



-319**-**

第1]	夏の制	売き						
⑦発	明	者	髙	山	修		東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オリンパス光学工業
	•						株式会社内	
個発	明	者	中	村	_	£В	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オリンパス光学工業
	•				•		株式会社内	
@発	明	者	中	村	· <u> </u>	成	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オリンパス光学工業
				•		•	株式会社内	•
@発	明	者	布	施	栄		東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オリンパス光学工業
		:	•	•			株式会社内	
個発	明	者	高	楯		進	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オリンパス光学工業
							株式会社内	
個発	明	者	小	坂	芳	広	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オリンパス光学工業
					•		株式会社内	•
個発	明	者	鈴	木	博	雅	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	オリンパス光学工業
					•		株式会社内	

手統補正 種(自発)

平成2年11月26日

特許庁長官 植松 敏段

1. 事件の表示 平成2年特許顯第259914号

2. 発明の名称 断層像観察用光走査装置

3. 補正をする者 事件との関係 特許出題人

> 住 所 東京都渋谷区幅ケ谷二丁目43番2号 名 森 (037)オリンパス光学工業は式会社 代表者 下 山 数 郎

4. 代理人

住 所 東京都新宿区西新宿7丁目4番4号 武蔵ビル6階 つ(371)3561 氏 名 (7623)弁理士 伊 裏 造

5. 補正命令の日付 (自 発)

6. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の概

7. 補正の内容 別紙の通り

将許庁 2.11.28 3 第 第 1. 明細書中第9ページ第6行から第7行に、 「このシングルファイバ先端に配置したミラーを 回転させて」とあるのを削除します。

2. 明細書中第10ページ第3行の「さらに、」の前に、「尚、前記光ファイバ28は、前記フレキシブルシャフト29に固定し、前記光ファイバ28と前記フレキシブルシャフト29とを同時に回転させるようにしても良い。」を挿入します。 3. 明細書中第11ページ第2行に、「G」とあるのを「6G」と補正します。